

POLOS® BEAM Mk2

- 0.1 μm 重复性和 4" 平台行程
- 分辨率为 0.8 微米

特点:

- 20x/0.75 NA 尼康紫外校正物镜
- 用于样品观察和多层对准的外延照明
- 全高清 120 FPS CMOS 摄像机，用于实时和无延迟观察
- 光学器件内置闭环自动对焦功能
- 压电驱动 Z 轴，实现快速自动对焦
- 用于系统控制的单 USB 3.1 接口

规格参数:

- 最小线宽: 0.8 微米
- 载物台双向重复性: 0.1 微米
- 曝光波长: 405 纳米
- 最大写入区域: 400 微米
- 写入面积: 106×106 毫米 (兼容 4 英寸)
- 包含 BEAM Xplorer 软件
- 包含高性能笔记本电脑